

ナノ・ライフ創新研究機構施設設備等(121号館)利用料金表

2017年4月1日改正②
2019年11月1日改正
2020年10月1日設置場所変更

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構では、企業が共同研究・開発等で研究施設等を利用する場合、施設・装置の使用料として以下の利用料金を徴収する。

利用料金は、以下の料金表に基づき各々の費目の合計金額を請求する。

1. 施設使用料+2. 装置使用料+3. 材料費+4. 消耗品費+5. 技術指導料+6. 一般管理費+

1. 施設使用料

1-1. 入室料

入室者1名に対して、室内環境の維持整備費として以下の利用料を徴収する。

実 験 室	料金 (円/日)	事 由
クリーンルーム (121号館202, 205, 207, B106室)	5,000 円/日	
その他の実験室 [化学実験室, 光学評価室, 基板加工室, 物性評価室, 電子顕微鏡室, 電気計測室など]	1,000 円/日	

2. 装置使用料等

利用料を徴収する装置は以下の表のとおり。(利用料は単価×利用時間)

なお、料金設定はメンテナンス費+光熱費+共通消耗品費を基礎に算定している。

設置場所	装 置	料金 (円/hr)	事 由
202	スパッタ装置(SPF332H)	2,500 円/hr	
202	スパッタ装置(SPF420L)	2,500 円/hr	
202	表面改質装置	2,500 円/hr	
202	XeF2エッチング装置	7,500 円/hr	
202	ALD装置	20,000 円/hr	
202	3連電気炉	2,500 円/hr	
202	RTA/RTO	2,500 円/hr	
202	プラズマCVD(TEOS)	7,500 円/hr	
202	Deep-RIE	12,500 円/hr	
202	ICP-RIE	5,000 円/hr	
202	CCP-RIE	4,000 円/hr	
202	レーザ顕微鏡(青)	2,500 円/hr	
202	プラズマリアクター	2,500 円/hr	
202	分光エリブソメータ	4,000 円/hr	
202	プラズマリアクター(CF4)	2,500 円/hr	
202	エリブソメータ	2,500 円/hr	
202	真空蒸着装置システム	2,000 円/hr	
205	レーザ顕微鏡(赤)	2,500 円/hr	
205	デジタルマイクロスコブ	2,000 円/hr	
205	イオンビームスパッタ装置(IFS)	7,500 円/hr	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
205	スパッタ装置(SPC350)	5,000 円/hr	
205	スパッタ装置(SPF430H)	5,000 円/hr	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
205	スプレーコーター	2,500 円/hr	
205	卓上SEM(Miniscopes)	2,500 円/hr	
205	EB蒸着装置(ULVAC)	5,000 円/hr	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
205	EB蒸着装置(ANELVA)	5,000 円/hr	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
207	UV露光装置(マスクアライナ)	1,250 円/hr	
207	EB描画装置 ELS-7700	11,000 円/hr	
207	EB描画装置 ELS-7500	11,000 円/hr	
209(F)	真空低温乾燥器	2,500 円/hr	
209(F)	ICP-MS	12,500 円/hr	Arガス代を含む
212	超純水製造装置	2,500 円/hr	
212	電解メッキ装置(人材育成)	2,500 円/hr	
212	プラズマアッシャー	2,500 円/hr	
212	プラズマアッシャー(ヤマト)	2,500 円/hr	
212	分極測定装置(HZ5000)	2,500 円/hr	
212	CMP研磨システム-1(卓上用)	2,500 円/hr	
212	CMP研磨システム-2	2,500 円/hr	
212	銅メッキ装置	2,500 円/hr	
212	金メッキ装置(酸・シアン簡易ドラフト)	2,500 円/hr	

212	ニッケルメッキ装置・恒温槽(アルカリドラフト)	2,500 円/hr	
212	磁場メッキ	2,500 円/hr	

設置場所	装 置	料金 (円/hr)	事 由
214(A)	顕微ラマン分光装置	5,000 円/hr	
214(A)	蛍光観察装置	2,500 円/hr	
214(B)	CCD顕微鏡(OMRON)	1,000 円/hr	
214(B)	ダイシングソー1(ディスコ)	2,500 円/hr	
214(B)	ダイシングソー2(ディスコ)	2,500 円/hr	
215(A)	磁気光学測定装置(Kerr効果)	2,500 円/hr	
215(A)	生体分子分離・抽出・固定用実験機器一式	2,500 円/hr	
215(A)	薄膜物性評価装置	2,500 円/hr	
215(A)	恒温槽(ヤマト化学DN600)	2,500 円/hr	
215(A)	電気特性測定装置	2,500 円/hr	
215(B)	グロー放電装置(GDOES)	5,000 円/hr	
215(B)	走査プローブ顕微鏡(AFM)	2,500 円/hr	
215(B)	AFM装置(ビーコ)	2,500 円/hr	
215(B)	触針式膜厚計tencor	2,500 円/hr	
216	FE-SEM(S-4800)	7,500 円/hr	
216	2Fイオンコータ	2,500 円/hr	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
216	汎用SEM	3,750 円/hr	
216	FIB/SEM(NB5000)	16,000 円/hr	学外者の長時間使用の際は要相談
216	卓上型精密研磨装置	2,500 円/hr	
216	イオンミリング(IM4000)	2,500 円/hr	
216	FE-SEM(SU-8240)	9,000 円/hr	
216	透過型電子顕微鏡	5,000 円/hr	
216	電界放出型電子顕微鏡システム S-5500	7,500 円/hr	
216	凍結乾燥機	2,000 円/hr	
216	イオンスパッタ	2,000 円/hr	
218	ナノデバイス評価装置(マイクロプローバ)	2,500 円/hr	
218	半導体パラメータアナライザ	2,500 円/hr	
218	ナノデバイス評価装置(恒温プローバ)	2,500 円/hr	
218	ESCA(1800MC)	5,000 円/hr	
218	FTIR	2,500 円/hr	
B103	高耐圧デバイス測定システム	7,500 円/hr	
B103	高周波測定装置	2,500 円/hr	
B103	半導体パラメータアナライザ(B1500A)	2,500 円/hr	
B106	エキシマ照射装置2	2,500 円/hr	
B106	接触角計	2,500 円/hr	
B106	エキシマ照射装置1	2,500 円/hr	
B106	UVインプリント装置	2,500 円/hr	
B106	AFM	2,500 円/hr	
B106	AFM装置(島津)	2,500 円/hr	
B106	ウエハーボンダー SB6e	5,000 円/hr	
B106	プラズマ活性化装置 PL8	2,500 円/hr	
B106	アライメント装置 BA8Gen3	5,000 円/hr	
B106	大気圧プラズマ装置	2,500 円/hr	
B106	ロールtoロール微細転写装置	2,500 円/hr	
B106	イオンミリング装置	7,500 円/hr	
B106	低温・ドライ還元装置	2,500 円/hr	
B106	ボンド用アライナーEVG620	2,500 円/hr	
B106	卓上顕微鏡(Miniscope)	2,500 円/hr	
B106	MFP-3D-10-OLY分子間プローブ顕微鏡システム	2,500 円/hr	
B120	分光光度計	2,500 円/hr	
B120	超音波ボンダ	2,500 円/hr	
B120	ダイボンダ	2,500 円/hr	
B120	磁歪測定装置	2,500 円/hr	

B120	半導体パラメータアナライザ(4200-SCS)	2,500 円/hr	
B120	CCD顕微鏡	1,000 円/hr	
LB016	粒子及び平板ゼータ電位測定装置 Zeta-Voltage Mesurement System	2,000 円/hr	

3. 材料費

種 別	内 容	単価(単位)		備 考
基板	Siウエハー(4インチ)、ガラス基板(4インチ)、	時価	円/枚	購入時の原価から算出
	標準マスク材料	時価	円/枚	購入時の原価から算出
	デバイス材料	時価	円/個	購入時の原価から算出

4. 消耗品費

種 別	内 容	単価(単位)		備 考
一 般	有機試薬、高圧ガス、貴金属試薬、特殊ガス、レジスト等	時価	円/式	プロセスに必要なものとして必要により徴収する
スパッタ材料	貴金属 Au、Pt等	時価	円/g	使用量×購入単価
蒸着材料	貴金属 Au,Pt等	時価	円/g	使用量×購入単価

5. 技術指導料

機構に所属する研究者等が実施する実習、装置トレーニング、デバイス作製、データー測定・解析・評価、情報提供等に関して以下の技術指導料を徴収する。

	種別	資格	単価(単位)		単価 (円/日)
1	A	教授・准教授	7,000 円/hr		56,000 円/日
2	B	講師・助教	6,000 円/hr		48,000 円/日
3	C	研究助手(40歳以上)	5,000 円/hr		40,000 円/日
4	D	研究助手・PD	4,000 円/hr		32,000 円/日
5	E	大学院生	2,500 円/hr		20,000 円/日

6. 自主事業

自主事業(成果非公開)の装置使用料は、大学、公的機関、企業を問わず、通常の企業の装置使用料の2倍とする。

7. 一般管理費

早稲田大学内における事務処理経費として上記1. 施設利用料、2. 装置利用料、3. 材料費、4. 消耗品費、5. 技術指導料の合計額の20%を徴収する。

8. 消費税

1. 施設利用料、2. 装置利用料、3. 材料費、4. 消耗品費、5. 技術指導料、6. 一般管理費の合計額に対する消費税を徴収する。